

检 测 报 告

TEST REPORT

检测编号: KDHJ2513256

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	褚亚男	联系电话	18800574369
采样日期	2025-11-03~2025-11-05	分析日期	2025-11-03~2025-11-07
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：丁玉清</div> <div>审核：黄凯华</div> <div>签发：邵娇娇</div> <div>检测机构检验章</div> <div>签发日期：2025 年 11 月 21 日</div> <div></div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	16.8	16.9	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		49488	50381	51028	50299	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.37	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	16.9	16.9	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		51402	51938	52013	51784	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	16.9	16.9	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		51402	51938	51938	51759	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.43	0.44	0.34	0.40	10
	排放速率（kg/h）	0.021				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	16.9	16.9	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		49488	51028	52013	50843	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	17.3	17.8	17.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		35872	37100	38001	36991	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.30	0.29	0.41	0.33	10
	排放速率（kg/h）	0.012				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.8	18.1	18.1	18.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		38516	40187	38425	39043	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	17.8	18.1	17.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		35872	38001	38425	37433	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	17.4	17.4	17.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		35803	36569	38150	36841	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.40	ND	0.25	0.25	5.0
	排放速率（kg/h）	9.2×10 ⁻³				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.52	0.34	0.43	0.43	10
	排放速率（kg/h）	0.016				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.3	16.9	17.1	17.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		38902	39243	39708	39284	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	17.4	17.1	17.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		35803	38150	39708	37887	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.1	18.1	18.1	18.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		38062	38604	40028	38898	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	0.47	0.22	5.0
	排放速率（kg/h）	8.6×10 ⁻³				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.4	18.1	18.3	18.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		39717	40645	40358	40240	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.43	0.39	0.39	0.40	10
	排放速率（kg/h）	0.016				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.1	18.1	18.3	18.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		38062	40028	40358	39483	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.1	20.3	20.3	20.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		18280	16433	17214	17309	/
氨	排放浓度(mg/m³)	1.24	0.77	0.63	0.88	10
	排放速率（kg/h）	0.015				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.4	20.5	20.5	20.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		14566	14029	14023	14206	/
氨	排放浓度(mg/m³)	0.73	0.63	0.80	0.72	10
	排放速率（kg/h）	0.010				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.5	20.5	20.6	20.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		11099	11365	12416	11627	/
氨	排放浓度(mg/m³)	0.67	0.60	0.63	0.63	10
	排放速率（kg/h）	7.3×10 ⁻³				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.4	19.2	19.2	19.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		20351	21443	21170	20988	/
氨	排放浓度(mg/m³)	0.53	0.36	0.36	0.42	10
	排放速率（kg/h）	8.8×10 ⁻³				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.3	20.4	20.2	20.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		17913	17923	18197	18011	/
氨	排放浓度(mg/m³)	0.46	0.29	0.43	0.39	10
	排放速率（kg/h）	7.0×10 ⁻³				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（11 月 3 日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.7	20.7	20.7	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		8089	7920	7412	7807	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.40	0.31	1.51	0.74	10
	排放速率（kg/h）	5.8×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	17.0	17.0	17.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		30432	30740	32255	31142	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.21	0.64	0.32	5.0
	排放速率（kg/h）	0.010				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.40	0.38	0.40	0.39	10
	排放速率（kg/h）	0.012				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	17.6	17.6	17.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		33104	33726	33282	33371	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.30	ND	ND	0.12	1.5
	排放速率（kg/h）	4.0×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-22 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	17.0	17.6	17.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		30432	32255	33282	31990	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.9	17.9	17.9	17.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		28286	27837	28463	28195	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.20	0.22	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.9	18.2	18.2	18.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		29405	28803	28875	29028	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	0.32	ND	0.13	1.5
	排放速率（kg/h）	3.8×10 ⁻³				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.32	0.32	0.42	0.35	10
	排放速率（kg/h）	0.010				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.9	17.9	18.2	18.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		28286	28463	28875	28541	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	17.2	17.1	17.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		32210	32915	34237	33121	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.99	0.24	ND	0.44	5.0
	排放速率（kg/h）	0.015				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.32	0.26	0.48	0.35	10
	排放速率（kg/h）	0.012				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.1	17.0	17.0	17.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		34258	34607	34400	34422	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.27	ND	0.38	0.23	1.5
	排放速率（kg/h）	7.9×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	17.1	17.0	17.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		32210	34237	34400	33616	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.5	18.0	17.9	18.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		29743	31226	31399	30789	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.44	ND	0.21	5.0
	排放速率（kg/h）	6.5×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-30 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.9	17.9	17.3	17.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		30205	30096	28685	29662	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.52	0.23	ND	0.26	1.5
	排放速率（kg/h）	7.7×10 ⁻³				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.48	0.38	0.47	0.44	10
	排放速率（kg/h）	0.013				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.5	17.9	17.3	17.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		29743	31399	28685	29942	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		20.5	21.0	21.4	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		2565	2627	2751	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	30	26	35	35	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.7	20.8	21.0	20.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		2631	2564	2627	2607	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.1	19.6	19.9	19.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		1046	1139	1232	1139	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表（11 月 4 日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.5	23.6	23.7	23.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		1404	1310	1403	1372	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.43	0.38	0.84	0.55	10
	排放速率（kg/h）	7.5×10 ⁻⁴				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（11 月 5 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	17.8	18.2	17.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		31370	33402	35486	33419	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.37	0.44	0.48	0.43	5.0
	排放速率（kg/h）	0.014				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.38	1.41	0.94	0.91	10
	排放速率（kg/h）	0.030				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（11 月 5 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.2	18.3	18.1	18.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		35598	35117	35271	35329	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-38 固定污染源废气检测结果表（11 月 5 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	18.2	18.1	17.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		31370	35486	35271	34042	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-39 固定污染源废气检测结果表（11 月 5 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.0	20.8	20.8	20.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		27396	27939	28974	28103	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.34	0.66	0.70	0.57	5.0
	排放速率（kg/h）	0.016				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.56	1.37	0.56	0.83	10
	排放速率（kg/h）	0.023				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-40 固定污染源废气检测结果表（11 月 5 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.3	20.5	20.5	20.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		30222	29635	30201	30019	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-41 固定污染源废气检测结果表（11 月 5 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.0	20.8	20.5	20.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		27396	28974	30201	28857	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-016-39	全自动烟气采样器	MH3001
F-010-08	离子色谱仪	883
X-016-41	全自动烟气采样器	MH3001
F-010-21	离子色谱	ECO IC
X-015-79	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-30	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
F-014-22	离子计	PXSJ-216
X-016-43	全自动烟气采样器	MH3001
X-060-06	充电便携采气桶	labtm009
F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-046-22	数字温度表	6801
X-015-102	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-016-40	全自动烟气采样器	MH3001
F-001-14	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-010-06	离子色谱仪	883

*****报告结束*****